This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

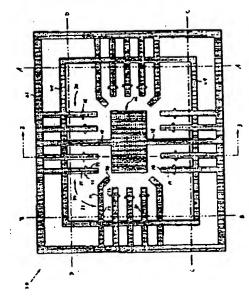
(II)特許出顧公開養号 特開2000-150765

(P2000-150765A) (43)公開日 平成12年5月30日(2000.5.30)

(51) Int.CL'	識別記号	FI			5-73-1*(参考)
HOIL 23/50	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	HOIL 23/50		υ	
				ŀ	Н
				F	R
23/12		23	3/28	-	A
23/28		23/12		F	
7.		密查請求	未請求	国東項の数32	杏飯 (全 19 頁)
(21)出顧書号	特顧平11-325884	(71)出題人	5991621	85	
(CI/DIBON 3			アムコ・	ール テクノロ	ジー、インコーポレ
(22)出顧日	平成11年10月12日(1999, 10.12)		ーチッ	۴	
			アメリ	カ合衆国 アリン	ノナ州 85248-
(31) 優先権主張者号	09/176, 614		1604,	チャンドラー。1	サウス ブライス
(32) 優先日	平成10年10月21日(1998.10.21)		n-4	1900	
(33)優先權主張国	米国 (US)	(71)出版人			
			•	セミコンダク:	タ, インコーポレー
			テッド		
		1	韓国 ソウル 133-120, スンドンーク,		
			スンス 2ーガ 280-8		
		(74)代理人			
			井建士	内駅 晋	
					最終更に観

(54) [発明の名称] 半等体象積回路プラスチックパッケージ、およびそのパッケージの製造のための超小型リードフレームおよび製造方法

(57)【要約】 (修正有) 【課題】 半導体集積回路の改良型プラスチックパッケージとその製法ならびにそのためのリートフレーム。 【解決方法】 パッケージはダイ、ダイパッド、ボンティングワイヤと割止材とからなる。 金属リードフレーム 2 0 のダイパッド 2 2 およびリード 3 0 の下側表面はエッチングにより階段状のプロフィルを形成し、ダイパッド・リードの凹んだ面を割止材で満たし、リードフレームがパッケージ本体から垂直方向に引き抜かれないようにする。またリードに耳部 3 6 を設け パッケージ本体からリードが水平方向に引き抜かれないようにする。



20

【特許請求の範囲】

【請求項1】半導体集積回路テバイス用のバッケージで あって、

実質的に平面状の第1の表面と、この第1の表面の反対 側にある実質的に平面状の第2の表面と、前記第1の表 面の反対側の前記第2の表面の周縁部て垂直方向に前記 第1の表面および前記第2の表面の間にある実質的に平 面状の第3の表面とを有する全局のダイバットと

前記ダイパッドの前記第1の表面に配置した半導体集積 回路デバイスと

実質的に平面状の第1の表面と、この第1の表面の反対 側にある実質的に平面状の第2の表面と、前記第1の表 面の反対側の前記第2の表面の周縁部で垂直方向に前記 第1の表面および前記第2の表面の間にある実管的に半 面状の第3の表面とを各々か有する複数の全属リート

前記半導体集員回路デバイスに設けてある導気性バット と前記金属リードの前記率1の表面との間をそれそれ接 続する複数の導体と、

前記ダイパットの前記第3の表面および前記金属リート の顧記第3の表面を覆い パッケージ本体を形成するエ ンキャプスレーション材とを合み、煎記金属リードの前 記事2の表面が前記パッケージの第1の外側表面で露出 し、前記金属リードの前記第1の表面が前記ダイバット の新記簿 1 の平面と同一の水平面内またはその水平面以 下にあるパッケージ。

【請求項2】前記ダイパッドの前記第1の表面が前記金 属リードの前記第1の表面と同一の水平面内にあり、前 紀ダイパッドの前記第2の表面が前記パッケージの前記 第1の外側表面で露出している請求項1記数のバッケー 30 一状に配置されている請求項1記載のバッケージ。

【鯖木項3】前記金属リートの前記第2の表面が円形の 四線を育する請求項2記数のパッケーン。

【諡水項4】前記金属リートの前記第2の表面が長方形 の関鍵を有する路水項2記載のパッケージ。

【論求項5】前記パッケージの前記第1の外側表面が周 辺却を有し、前記金属リードの全部または複数の一部が その周辺部にある請求事2記載のバッケージ。

【請求項6】前記パッケーンの前記第1の外側表面が周 辺部を有し、前記全属リードの全部または複数の一部の 40 前記第2の表面が前記回辺部の内側にあって前記エンキ サプスレーション材を前記周辺部と前記全局リートの各 4の前記第2の表面との間に留めるようにする語示項で 記数のパッケージ。

【請求項7】前記周辺部の内側に第2の表面を各ちが有 する前紀金属リードが前記金属リードの前記第1の表面 の反対側に実質的に平面状の第4の表面。すなわち垂直 方向には前記金属リードの前記第1の表面と前記年2の 表面との間にあり借方向には前記全属サートの前記第2 の表面と前記れ、ケーシの前記第1の外側矛面の前記周(5)。前記フレームの内側に配置されて前記フレームに接続さ

2 辺鄙との間にある第4の表面を有する語水項6記載のパ ッケージ。

【請求項8】前記パッケーシが固縁側部を有し、それら 周縁側部から延びる第1の部分を複数の前記金属リート が有する請求項2記載のバッケージ。

【請求項9】前記全属リートの前記第1の部分が上向き に曲げてある請求事8記数のパッケーン。

【請求項10】前記タイパットの前記第1の表面が周線 部を有し、前記半導体集機回路テバイスが前記ダイバッ 上の前記周縁部を趋えて延びる請求項上記載のバッケー

【請求項】】】前記半導体集積回路テバイスが前記金属 リードの一部を絶えて延びる請求項10記載のバッケー

【論末項10】前記パッケージが回緯側部辺を有し、前 記半導体集積回路テバイスの側部辺が前記周縁側部辺よ りも約0.1ミリスートル以下内側にある請求項11記 蚊のバッケージ。

【請求項13】前記半導体集積回路テバイスの第1の側 部辺」すなわち前記パッケージの周線側部辺から約0. 6ミリメートル内側の第1の側部辺の近傍の導電性パッ トに導体を接続した請求項11記載のバッケーシ。 【箱水理14】厚さが約0、50ミリメートル以下の箱 求項2記載のバッケージ。

【論求項 】5 】前記全属リードの前記第 1 の表面と前記 第3の表面との間の垂直方向の距離が前記金属リートの 前記第1の表面と前記第2の表面との間の垂直方向の距 敵の約5 (1%である請求項2記載のパッケージ。

【請求項】6】前記金属リードの前記第2の表面がアレ

【請求項17】前記金属リートの複数の一部が損方向曲 け部を含む請求項2記載のバッケーン。

【請求項】8】前記全属リートの複数の一部が操方向曲 け部を含む請求項1 ()記数のバッケーン。

【請求項】9】前記ダイバットの前記率1の表面が周縁 部を有し、前記半導体集長回路デバイスが前記ダイバッ ドの新記回縁部を越えて延びる請求項17記載のバッケ - 22.

【論才項20】前記半導体集積回路テバイスが前記全局 リートの一部を絶えて延びる請求項19記載のバッケー

【詩水項21】前記全局リートの前記率2の表面がテレ 一株に配置されていて円配の国味部を有し、それら全居 リートの複数の一部が構方向曲げ部を含む請求項10記 飲のバッケーン。

【請水事22】エンキャブスレーションを飾した半導体 集機回難パッケージの製造のための金属リートフレーム ておって、

切り捨て可能な金属フレームと

れ、実質的に平面状の第1の表面と この第1の表面の 反対側にある実質的に平面状の第2の表面と、前記第1 の表面の反対側の前記第2の表面の周縁部で垂直方向に 前記集1の表面および前記第2の表面の間にある実質的 に平面状の第3の表面とを有する全国のタイパットと、 前記プレームから前記ダイバットに向かってそのダイバ ッドと接触することなくそれぞれ延び 実質的に平面状 の第1の表面と この第1の表面の反対側にある実質的 に平面状の第2の表面と 前記第1の表面の反対側にあ り垂直方向には前記第1の表面および年2の表面の間に 10 ある実質的に平面状の第3の表面とを各々か合む複数の 金属リードとを含む金属リートフレーム。

【請求項23】エンキャプスレーションを鈍した複数の 半導体集積回路パッケージを同時並行的に製造するため のパターニングすみの金属条片であって、

複数の相互接続した切り捨て可能なマトリクス状の複数 の金属フレームと、

育記プレームの各々の内側に配置されてそのフレームに 接続され、各々が実質的に平面状の第1の表面と この 第1の表面の反対側にある実質的に平面状の第2の表面 20 と、前記第1の表面の反対側の前記率2の表面の周縁部 で垂直方向に前記第1の表面および前記第2の表面の間 にある実質的に平面状の第3の表面とを有する全属のグ イバッドと、

前記フレームの各ヶから前記ダイバットに向かってその フレームの中でそのダイバッドと接触することなくそれ ぞれ延び、実質的に平面状の第1の表面と、この第1の 表面の反対側にある実質的に平面状の第2の表面と、前 記集1の表面の反対側にあり垂直方向には前記第1の表 面および第2の表面の間にある実質的に平面状の第3の 30 表面とを含む複数の金属リードとを含むパターニングす みの全層条片。

【請求事24】半導体集機回路テバイスのためのバッケ ージを製造する方法であって、

リートフレーム。すなわち切り建て可能な金属のフレー ムと、そのフレームの内側にあってそのフレームに接続 された金属のダイパッドであって実質的に平面状の第1 の表面と、この第1の表面の反対側にある実質的に平面 状の第2の表面と、前記第1の表面の反対側の前記第2 の表面の周縁部で垂直方向に前記第1の表面および前記 第2の表面の間にある第3の表面とを含むダイバットと を有するリードフレームであって、前記フレームから前 記ダイパットに向かって前記タイパートに接触すること なくそれぞれ延び、実質的に平面状の第1の表面と、こ の第1の表面の反対側にある実質的に平面状の第2の表 面と、前記第1の表面の反対側の前記等2の表面の風縁 部で垂直方向に前記第1の表面および軍令の表面の間に ある実質的に平面状の第3の表面とを各ヶが有する複数 の金属のリートを含むリートフレームを準備する過程 ځ

半導体集積回路テバイスを前記ダイバットの前記第1の 表面に就屈する過程と、

前記半導体集員回路テバイス上の複数のボンティンクバ ットの一つを前記リートの各っの前記年1の表面に意気 的に接続する書程と、

前記半導体集長回路テバイス。前記ダイバットおよび前 記サートの前記第1の表面および前記タイパットおよび 前記リートの前記簿さの表面を覆い前記リートの前記簿 2の表面を露出させるようにエンキャプスレーション材 を塗布する過程と、

前記エンキャプスレーション材を硬化させる過程と、 前記ダイバットおよび前記リートを前記フレームから切 り離し、パッケージ完成品を前記リートフレームから切 り離し、前記リードの前記第1の表面を前記タイパット の前記第1の表面と同じ半平面内またはその水平面より も低い平面内に位置つける過程とを含む方法。

【請求項25】前記エンキャプスレーション材が前記タ イパットの前記年2の表面を露出させるように また前 記ダイバットの前記第1の表面を前記パッケーンの前記 リートの前記第1の表面と同じ水平面内に位置づけるよ うに盆布される請求項24記載の方法。

【請求項26】前記ダイバットおよび前記リートの露出 した前記第2の表面を前記エンキャブスレーション材の 建布役で前記切離しの前に左肩でメッキする過程をさら に含む請求項25記載の方法。

【請求項27】前記リードの切断を 切断後の前記リー Fの各々の第1の部分が前記エンキャプスレーション材 の外側に延びるように行う請求項25記載の方法。

【請求項28】前記リードの前記第1の部分を前記パッ ケージ本体の前記第1の表面に対して上向きに曲げる過 程をさらに合む請求項27記載の方法。

【請求項29】複数の半導体集績回路テバイスバッケー シを同時並行的に製造する方法であって、

パターニングすみの全席条片、すなわち複数の使い語で 可能な相互接続すみのマトリクス配列の金属フレームを 含むパターニングずみの金属条片であって、前記フレー ムの各々の内側にあってそのフレームに接続され 実質 的に平面状の第1の表面と この第1の表面の反対側に ある実質的に平面状の第2の表面と「前記第1の表面の 40 反対側の前記率2の表面の周線部で垂直方向に前記第1 の表面および前記第2の表面の間にある第3の表面とを 各々が合む全属のタイパットを有するとともに「前記で レームの各っからそのフレームの前記タイパットに向か って前記タイパットに接触することなくそれぞれ延び 実質的に平面状の第1の表面と、この第1の表面の反対 側にある実質的に平面状の第2の表面と、前記第1の表 面の反対側の前記第2の表面の周縁部で垂直方向に前記 第1の表面および第2の表面の間にある実質的に平面状 の第3の表面とを各っが有する複数の全席のリートを有じ 50、するハツーニングすみの座属条片を準備する過程と

前記半導体集長回路テバイスの各ヶの上の複数のホンテ ィングパッドの一つをその半導体集績回路テバイスと同 **一のフレーム内の一つのリードの前記第1の表面に名気** 的に接続する過程と、

前記半導体集機回路テバイス。前記タイパットおよび前 記リードの前記第1の表面および前記ダイバットおよび 前記リートの前記第3の表面を覆い前記リートの前記第 2の表面を露出させるようにエンキャプスレーション材 を途布する過程と、

前記エンキャプスレーション材を硬化させる過程と、 前記ダイパッドおよび前記リートを前記プレームからそ れそれ切り難し 複数のパッケージ充成品を前記至属条 片から切り難し 前記パッケージの各々の前記リードの 前記第1の表面を前記ダイバットの前記第1の表面と同 じ水平面内またはその水平面よりも低い平面内に位置づ ける過程とを含む方法。

【論水項30】前記エンキャプスレーション材が前記タ イパッドの前記第2の表面を露出させるように また前 記ダイパッドの前記第1の表面を前記パッケージの前記 リートの前記第1の表面と同じ水平面内に位置づけるよ 20 うに遂布される請求項29記載の方法。

【論水項31】半導体集横回路パッケージを製造するた めの金属リードフレームを製造する方法であって 金属落板を準備する過程と

前記金周薄板の所定部分を除去して フレームとそのフ レーム内にあってそのフレームに接続されているダイバ ッド、すなわち実質的に平面状の第1の表面とその反対 側の実質的に平面状の第2の表面とを含むダイバッド と、前紀フレームから前記第パットに向かってそのダイ パッドに接触することなくそれぞれ延び各ヶが実質的に 30 平面状の第1の表面およびその反対側の実質的に平面状 の第2の表面を含む複数のリート とを含むリートフレー ムを形成する過程と、

前記リードフレームの前記タイパットおよびリートの一 方の側の所定の部分にパターニングすみのフォトレジス トマスクを建布する過程と

前記ダイパッドおよびリートの一部を化学的にエッチン グして前記ダイバッドおよびリートのマスクなしの部分 を除去し前記タイパッドおよび前記リートの各々に実質 記第1の表面の反対側にあり前記タイパットの前記第2 の周轉で垂直方向に前記タイパットの前記第1の表面と 前記第2の表面との間にある前記タイパットの第3の表 面。および前記リードの各々の前記第1の表面の反対側 にあって垂直方向に前記リートの前記第1の表面と前記 リードの前記率2の表面との間にある前記リートの第3 の表面を形成する過程とを含む方法。

【請求項32】前記除去する過程がバターニングすみの フォトレジストマスクを耐記全局薄板に塗布する過程

仮の所望の部分を除去する過程とを含む請求項31記載 の方法。

【発明の詳細な説明】

100011

【発明の鷹する技術分野】本発明は半導体集積回路ク イーすなわち半導体集積回路チップのための改良型プラ スチックパッケージ。およびこの種のパッケーシを製造 するための方法およびリートプレームに関する。

[0002]

10 【発明が解決しようとする課題】半導体集積回路チップ は 有害な環境からの保護および集長回路・印刷配線回 路芒板間の電気的相互接続のために ブラスチックパッ ケージに通常密封する。この極のパッケージの構成要素 としては、金属リードフレーム、半導体集積回路チャ **プーその半導体集積回路チップをリートフレームに付着** させる結合材、半導体集債回路チップ上のコンタクトパ ットをリートプレームの個々のリートに電気的に接続す るポンディングワイヤおよびこれら素子を覆ってハッケ ーシ外貌を形成する硬質プラスチックのエンキャプスレ ーション材などがある。

【0003】リードフレームはこの種のパッケーシの中 心的な支持構成物である。サートプレームの一部はパッ ケージの内側にあり、プラスチックのエンキャプスレー ション材に完全に取り囲まれている。リートアレームの サードの一部はバッケージから外部に延びてバッケージ の外部接続に用いられる。

【①①()4】個用のプラスチック集機回路パッケージお よびリードフレームに関するさらに詳しい背景偵報はニ ューヨーク州ニューヨーク市フィフスアヴェニュー11 4所在のVan Nostrand Reinhold 注1989年発行のR. TummalaおよびE. R ymaszewsk i共績の専門会「Microele ctionic Packaving Handbee k」の第8章に記載されている。

【0005】従来のプラスチックパッケージの問題点 は、内部のリードフレームのためにバッケージの小型化 が制限されることである。Rocheほか名義の米国特 許年4、530、142号およびCastro名義の未 国特許第5、172、213号に記載されているとお 的に平面状の第3の表面。すなわら前記タイパットの前。40~9。当業者はリートフレーム除去によるパッケーン小型 化を試みたが、それらパッケーシは多数の欠点を伴う。 上記米国特許第4、530、142号記載のパッケージ のコンタクトは直交の側面を有する。したかって、コン タクトがエンキャプスレーション材から容易に引きばか されてバッケーンの信頼性が低下する。上記米国特許第 5、172、213号記載のパッケージは集積回路チッ プ上のパットから上方に垂直に延びる曲げリートを備え る。このようなサートをバッケージ内に合むので製造コ ストが上がり、バッケージの小型化が阻塞される。した と「前記金属薄板を化学的にエッチングして前記金属溝」切っかって、より小さくより信頼性の高いプラスチックバッ

ケージが必要である。

100061

【課題を解決するための手段】この発明は半導体集積回 路チップを収容する改良型プラスチックバッケージ。お よびそのパッケージの製造のためのリートフレームおよ び方法にある。この発明の一つの実施例による組立て方 法における工程(では全属リートフレームを準備する。 そのリードフレームは切り捨て式の長方形のフレームを 含む。ダイバッドをそのフレームの中に設けてあり、そ のフレームに接続してある。フレームから横方向に複数 10 のリードがダイバッド との接触なしに ダイパッド方向に 延びている。

【0007】リードフレームのダイバットは長方形の周 辺を有する。ダイパッドは水平な第1の表面を有し、パ ッケージ組立ての際にその上にダイを数せる。この第1 の表面の反対側には実質的に平面状の中央部の第2の表 面があり、周辺部の第3の表面がある。この第3の表面 は第2の表面の周縁にあり 第2の表面から垂直方向に 凹んでいて、ダイパッドの下側表面が階段状のブロフィ ールを示すようにしてある。パッケーシ充成品ではエン 20 キャプスレーション材がダイバットの上記の凹んだ第3 の表面の下側を満たしているがダイバッドの第2の表面 は置っていない。ダイパットの第3の表面の下のエンキ ャプスレーション材はダイバットがパッケージから垂直 方向に引っ張られるのを防止する。

【0008】 各リードは第1の表面と この第1の表面 の反対側の第2の表面と、同様に第1の表面の反対側で 第2の表面の近傍の第3の表面とを備える。第2の表面 は長方形または円形の四線を有する。第3の表面は階段 状プロフィールのリードの下側表面に至る第2の表面か 30 **与垂直に凹んでいる。パッケージ完成品ではリートの第** 3の表面の下をエンキャプスレーション材が満たしてい るが、リードの第2の表面を覆ってはいない。リートの 第2の表面はLCCパッケージの場合と同様にパッケー ジの外部接続のためのコンタクトとして、または半田は の技装のためのランドとして作用する。リードの第3の 表面の下のエンキャプスレーション村はリードがバッケ ージから垂直に引っ張られるのを防止する。

【0009】リードフレームは色いた至陽奈片から2工 程は金属条片をエッチングで貫通する片面または西面エ **ゥチングであって、それによって、リートフレームの所** 望の全体パターンを全居条片に転写する。第2のエッチ ング工程はダイの周辺およびリートの所定部分をエッチ ングする工程である。第2のエッチング工程はダイパッ ドおよびリードの厚さの一部をエッチングし、それによ って上述の垂直方向に凹んだ平面状または実質的に平面 状の第3の表面をタイパットおよびリートに形成する。 【0010】工程2ではタイパットの上側の第1平面の 上に半導体集構回路を載せる。用途に応じて、タイの面、50~は、バッケージをチップと同号の大きさにすることもで

槓はダイパットの第1の表面の面積よりも小さくする か。またはダイバットの周韓部からダイがはみ出すよう に大きくしても差し支えない。

【① 011】工程3 はダイのボンティングバットの各っ と各リートの第1の表面との間をポンティングワイヤま たは同等の導体で電気的に接続する。ホンティングワイ ヤの核桃を受けるリート部分は、例えば親、全その他の 全属でメッキしておく。

【りり】2】工程4はタイおよひリートフレームの上向 きの第1の表面に高枯性の粘着性エンキャプスレーショ ン材を供給する。この工程のあとエンキャプスレーショ ン村は硬化する。このエンキャプスレーション村は、タ **イーポンティングワイヤーリードの第1の表面 ダイバ** ットおよびリートの第3の表面、およひダイおよびリー 下の側面を覆う。 ケイバットおよひ リートの第2の表面 はエンキャプスレーション村には覆われず、パッケーシ 下側外表面で露出している。

【0013】工程5においては、ダイバットおよびリー Fの露出した第2の表面などのリードフレーム露出表面 を 銅、金、鉛-亜鉛半田、鐸、ニッケル、パラジウム ほか半田付け可能な金属で半田付けする。用途およびり ードフレーム材料によっては、工程5は省略できる。 【①①14】工程6において、パッケージ充成品をエン キャプスレーションずみのリートフレームから切り離 す。より詳細に述べると、工程6はリードフレームの切 り捨て可能部分を除去する。すなわち 長方形リートフ レームなどのリードフレーム切り捨て可能部分をダイバ ッドおよびリードなとリードフレームの部品構成部分か **ら切り離す。工程4 におけるエンキャプスレーションの** 方法によっては 工程6でエンキャプスレーション材を 切ってパッケージの周辺を形成する。

【0015】工程6はリートフレームからリートを切断 する。この切断はダムバーの内側で行う。切断の場所に 応して、切断すみのリートの建部かパッケージの側部か ら損方向に延びる。工程6またはその後続の工程に、パ ッケージ側部で上記切断リードの突出機能を上に曲げて リート雑部がパッケージ下側外面におよびリードのエン キャプスレーション部分に傾斜角を成すようにする曲げ 工程を含めることもできる。バッケージを印刷配線基板 程温式エッチングにより形成する。第1のエッチングエー40 に半田付けする際に、パッケージ下側外面に露出したり ート水平都たけてなく切断リートの上向を曲げ篠部にも 半田を付けて、半田様様を芳めるのである。 バッケージ の下側表面は、バッケージ下面中心にあるタイパットの 第2の表面、リートの第2の表面およびパッケーンの下 面の秩余部分を形成しタイパッドもよびリートを互いに 分離する硬化すみのエンキャプスレーション材を含む。 【0.0.1.6 】この発明のバッケージは多数の利点を値 え、大島カテバイスやアナログデバイスなど多数の用途 に有用である。このバッケージは小型化できる。例え

10

さる。また、パッケージをごく薄くすることもできる。 この発明によると、厚さり、 5 ミリメートル以下のパッ ケージも製造できる。さらに、リードをダイのごく近傍 に配置してポンティングワイヤの長さを最小にすること がてさる。ダイハットの露出した第2の表面を ハッケ ージ冷却に備えて半田で印刷配根差板に結合することも

【0017】上述のリートフレーム バッケーンおよび 組立て方法の多数の変形をこの明細書に記載するか。こ れらはいずれもこの発明の一部を構成するものである。 例えば、一つの代替的組立て方法では複数のパッケージ の同時並行的製造を可能にするリードフレームを用い る.

[0018]

【発明の実施の形態】図1はこの発明による半導体集績 回路テバイスバッケージ祖立て方法の流れ図である。 図 5は図1の方法で製造可能なこの発明によるパッケージ の実施例を示す。

【0019】図1の工程1において全属フレームを準備 図である。リードフレーム20の金属部分をそれら金属 部分以外の空間から区別するように図2(ほかの図も同 じ」では陰影を付けて見やすくしてある。

【0020】図2のリードフレーム20は、用途に応じ て、銅、銅台垒(メッキ銅)メッキ銅合金、台金37 (ニッケル37%、銀55%の台金) 銅メッキ鋼なと 慣用のリードフレーム台金で構成する。

【0021】図2のリードフレーム20は周辺部の長方 影タイパー2~と中心寄りの長方形のダムバー29とを 備える(「長方形」が「方形」を含むことは当業者には 30 明らかであろう)。 複数のリードフレーム20を金属条 片にエッチングで形成したもの(何えば図16年頃)な ど代数的実施例(図示してない)ではタイパー21を省 略してリードフレーム四辺部を除後リートフレーム間の 金属条片の一部で形成することもできる。もう一つの代 替的実施例 (図示してない) ではタイパー21とタイパ ー21・ダムバー29間リード部分とを省略して リー ドフレーム外側フレームをダムパー29で構成すること もできる。

【0022】長方形国縁を有するダイバット22をタイ 49 パー21に接続してある。タイパット22はタムパー2 9の内側にある。二つの接続線2.8がダイバット2.0を ダムハー29およびタイパー21に接続している。図1 の工程6では、接続線30をタムハー28の内側でリー ドフレーム20から切り離す。

【0023】タイパー21からダムパー29経由でダイ パッド22の側面に向かって18本のリート30かタイ パッド22との接触なしに横方向に延びている。苔リー ト30の第1の編部34はタイパット22の近傍に位置 する。図1の工程もにおいて、名りートはフェルーでターが、部接続のために十分な大きさにする。果での新面3?は

とリート30の単1の端部34との間で切り離される。 代替の実施例(図示してない)では、リート30をタイ ハー21起点でなくダムバー39起点で設けることもで き。またダムバー29およびタイパー21を複数の対称 配置条片で接続することもできる。

【0.024】図2に示したサートアレーム2ののサート 30の位置もよび横方向経路は例示にすぎない。 これら リートの数、位置および債方向経路は用途によって変わ る。この発明の利点は特定の半導体業績回路フィのナン ディングパットの数および位置に柔軟に対処するように 設計できることである。

[0025] 図2の18本のリート30のうち14本は 直線状である。 これちリードのうち4 本はダムバー29 とダイパット22との間に損方向曲げ部を含む。直接状 リート30の各々は、そのリート30の機側面から垂直 方向に突出したアンカー耳部36を有する。アンカー耳 部はほぼ長方形であり、階接サートどうしの間で配置を 少しすらしてある。 バッケーシ充成品ではこれらアンカ 一耳部36はパッケージのエンキャブスレーション材と する。図2はこの発明によるリートフレーム20の平面 20 絡み合い、パッケージ本体からリート30が水平方向に 引き抜かれることがないようにする。アンカー耳部の代 わりにリード30中の食通孔または凹みをエンキャプス レーション材との格みに用いることもできる。

[0026] 図3は図2の練3-3で見たダムバー29 の平行部は内のリートプレーム20の断面図である。 タ イバット22および二つの互いに相対するリート30か 示してある。図示したリート30の各部分はタムハー2 9のすぐ内側から始まっている。ダイバット22および リード30の両方の下側表面は垂直方向に凹んた小平ま たは実質的に水平の表面を含む。

【0027】図3のダイバットごごは平面状の上側の第 1の表面23 平面状の反対側の第2の表面24 および 平面状の間じく反対側の第3の表面25を含む。これら 表面と直交する第1の側部表面27か第3の表面25と 第2の表面24との間にある。第3の表面25は第2の 表面2.4から深さ「H1」だけ垂直方向に凹んでいる。 すなわち、第3の表面25は垂直方向には第1の表面2 3と第2の表面24との間に位置する。 タイパット22 の中央部分は第1の表面23と第2の表面24との間の 一高さ「H」を有する。タイパット22の第3の表面25 は第2の表面24の国縁部にあり、一つの実施例ではこ の第2の表面24を取り囲んている。

【0028】四3のリート30の各々は平面状の第1の 表面31を含む、第1の表面31の反対側には平面状の 第2の表面32および平面状の第3の表面33かある。 第2の表面32はタムバー29から始まりタムバー29 の内側でタイパットな2に向かって少し延びる。この実 統例では、第2の表面32は長方形の周線を有する。第 2の表面の長さは用途によって変わるか。 バッケージ 外 第2の表面32とリート30のタイパット22近傍終端 34との間で延びる。第3の表面33は第2の表面32 から疎さ「Hl」だけ垂直方向に凹んでいる。すなわ ち、第3の表面33は垂直方向には第1の表面31と第 2の表面32との間に位置する。アンカー耳部36(図 示してない)がリード3()の第3の面33近傍の横方向 側部から垂直に延びている。

【0029】図1の工程6では、リートフレーム20の エンキャプスレーションのあと、リート30をダムバー 2 9 の内側で図2の直根A - A、B - B、C - Cおよび 10 D-D沿いに切り離す。この切断はリード30の早2の 表面32を含む部分で垂直方向に行う。 パッケージ完成 品では、切断されたリード30の各々の第2の表面32 がバッケージを直接的または間接的に外部の印刷配根基 板に接続するパッケージコンタクトとして作用する。パ ッケージ完成品ではリート30の第3の表面33はエン キャプスレーンテン材で覆われ、したかってパッケージ 本体の内側にある(図5)。

[0030] 図3のリードフレーム2 0のダイバッド2 O. 15乃至O. 50ミリメートル 凍さ「H1」の数 値例としては約0. 0.75万至0. 2.5ミリメートルが 挙げられる。ダイパッド22の水平方向インテント

「W」の数値例としては約0.025万至0.25ミリ メートルが挙げられる(これらの数値は図中「H」「H 1]「W」で示した部分にも迫合する)。 百分比でいう と、「H1」の値は「H」の値、すなわち第1の表面2 3および31と第2の表面24および32との間の距離 「H」の33%乃至75%の範囲または約50%であ る。実際の数値は用途によって変動する。

【0031】図2のリードフレーム20は色取り金属条 片から湿式エッチングによって形成する。周知の通り、 化学的エッチング (化学的ミリング) は、フォトリング ラフィ、フォトレジストー およひ金属溶解液状化生物質 を用いて金属条片にパターンをエッチンクで影成するブ ロセスである。通常は、まずフォトレジスト度をその金 属条片の片面または両面に付着させる。次に、そのフォ トレジスト度を所望のパターンのマスクを達して露光す る。そのフォトレジスト層を現像して硬化させ、パター ニングしたフォトレジストマスクを形成する。次に、こ のマスク形成ずみの条片の片面または荷面に化学物質を 吹き付けその他の方法で作用させる。至席条片の露出部 分はエッチングで辞去され 全居条片には所望のパター ンが残る。

【0032】図2および図3(図9 図13、図15お よび図16 6同様) のリートフレーム20を形成するの に二段階エッチング処理を用いる。 第1のエッチングエ 程では、金属条片の平面状表面の片面または両面に付着 させたフォトレジストバターンにしたかってその条片の 片面または両面からエッチングを進める。この第1のエー56 間中は接地しており、

ッチング工程で、全居条片の諸部分を完全に除去し、図 2に例示したとおり、リートプレームの全体的なパター ンを形成する。次に、ダイバッドの風味部およびリード の所望部分を第2のフォトレジストパターンで復わない まま露出させ、エッチング除去に適した状態にする。第 2のエッチング工程ではこの第2のフォトレシストバタ ーンにしたがって一方の側からリートフレームの厚さ方 向一部を除去する。この第2のエッチング工程で 図2 および図3のリートフレーム凹み面 すなわちタイパッ 122の第3の表面25およびリート30のダムバー2 9内側の第3の表面を形成する。 ダムバー29の内側で は 通常は接続線28もこの第2のエッチング工程にか ける。ダイパッドおよびリードの所望部分の所望の厚み がエッチングで除去されると、この第2のエッチング工 程を止める。すなわち、この第2のエッチング工程はダ イバットおよびリートの所望の部分を厚さ方向に部分的 にエッチング除去する。第2のエッチング工程によるエ ッチングの確さは、タイパット22およびリート30を パッケーシ本体に留めるに十分な量のエンキャブスレー 2およびリード30の高さ「H」の数値例としては、約 20 ション材がダイバット22の第3の表面25およびリー ト31)の第3の表面33の下を流れるようにする必要を 満たす値とする。 通常は第2のエッチング工程でダイバ ッドおよびリードの厚みの約5.0%を除去するが、この 値はダイパッドおよびリードの厚みの約3.3%乃至7.5 %の毎囲で定められる。エッチング処理のばらつきのた めに 第3の表面25および33は平面状でなくほぼ平 面状になるに留まり、ダイバッド22およびリート30 のエッチングした側壁は9.0°でなく丸みを帯びた角部 を伴うこともあろう。

【0033】リードフレーム20の形成を、順送り打抜 さにより全体的パターンを形成する工程と、打抜きすみ リードフレームのダイバットおよびリードを上述の化学 的エッチングにより揮み方向に部分的に凹み表面を形成 するように辞去する工程とによって行うこともてきる。 【1)()34】図1の工程2において半導体集積回路タイ 52をダイパッド22の第1の表面23の中央に軟せ る。パッド22へのダイ52の鉄屋および付着は個用の ダイ付着マシンおよび慣用のダイ付着エポキシによって 行うことがてきる。この工程2およびそれ以降の租立て 工程の期間中は 図2のリードフレーム20を辞電放電 に対するダイ保護のために接地しておく。

【0035】図1の工程3では、半導体集積回路タイち 2(図5)上の偏々のポンティングパットと個々のリー F 3 ()の第1の表面31との間を導電性金属ホンティン クワイヤ54またはその同等物で最気的に接続する。第 1の表面31は金、銀、ニッケル、バラジウム 鋼その 他の金属でメッキすることもできる。 図2のリートフレ ーム20は、許電飲意による半導体集積回路デバイスの 損傷を防ぐためにこのポンティン グワイヤ接続工程の期

【0036】図1の工程4では、図2のリートフレーム 2.0 に斉钻性の钻岩エンキャプスレーション材を入れ る。エンキャプスレーション材は半導体集積回路ダイ5 2.ポンディングワイヤ5 4、ダイバッド22の側方表 面2618よび27、ダイパット22の第1の表面238 よびダイ3の表面25、リーF30の第1の表面31、 第3の表面33および側方表面を覆う(図5)。タイパ ッド22の第2の表面およびリート30の第2の表面3 2はエンキャプスレーション材には覆われてなく露出し たままである。代替的実施例では、ダイバット22をエ ンキャプスレーション工程のあいだ裏返しにして ダイ パッド22の第2の表面24の下にエンキャプスレーシ ョン村の薄い唇が形成されるようにする。その実施例で は、ダイパッド22はパッケーシ本体の内部に全体が入

13

る。最後にエンキャプスレーション衬を硬化させる。 【0037】図1の工程4を行うには用途に応じていく つかの方法がある。例えば 図1の工程4は慣用のブラ スチックモールド手法を用いて行うこともできる。その 手法では、図2のリードフレーム20を型の中におき、 図4に示すとおり、リードフレーム20の上に固体成型 20 エンキャプスレーション村プロックを形成する。このエ ンキャプスレーション材は慣用の手法を用いて導入した 慣用のプラスチックモールド材料である。 このモールド 材料としては、日本の日東電工から市販されているモー ルド村日東MP-8000ANおよび圧友から市販され ているモールド村EME7351UTなどが挙げられ る。モールド処理の円滑化のため、リードフレーム20 に慣用のゲートを設けることもできる。型の側面は完成 品取出しを容易にするためにテーパー状にする。

液状エンキャプスレーション材の利用によって行うこと もできる。例えば、図2のリードフレーム20をまず水 平表面上におく。第2のステップとして、カリフォルニ ア州インダストリー所在のDexler-Hysol仕 市販のHYSOL4451エポキシなど慣用の硬化可能 な高粘性粘着材の互いに隣接するピーズをリードフレー ム20に塗布して、ダイ52の周囲およびリード30の 少なくともダムバー29内側部分に関じた長方形のダム を形成する。第3のステップとして、140℃で1時間 加熱してそのビーズを硬化させる。第4のステップとし、40 て、HYSOL4451液状エンキャプスレーション材 などパッケージのエンキャプスレーションに迫した慣用 の硬化可能な高格性結番材をピースの内側に連布してタ ム内部の不完全なパッケージをエンキャプスレーション 材で覆うようにする。最後のステップとして、140℃ で!時間加熱してエンキャプスレーション材を硬化さ せ、リードフレーム20上にエンキャブスレーンタン材 の一つの固体プロックを形成する。この手法を工程4に 用いた場合は、工程もは据を用いてエンキャアスレージ ョン鉢を切断し、直交パッケーを側面を形成するととも、50、の子側の第2の差面52とデーバ付き側面55とを有す

にリートフレームからバッケーシ完成品を切り離す。同 様のモールト処理およびそれに続く個によるリートフレ ーム・パッケージ切断工程は1998年6月24日提出 の米国特許出職第09/103,760号に記載されて おり ここに参照してその記載内容をこの明細書に組み 入れる。

[0039] 図1の工程5では、図2のリートフレーム 21)の雑部分のうち、ダイバット22の第2の表面2 4.リート30の第2の表面32などエンキャブスレー ション材で覆われない部分を、印刷配牌基板と両立性あ る慎用のメッキ金属でメッキする。 このメッキ金属の例 としては、用途に応じて坐。ニッケル、パラジウム、イ ンコネル、鉛糯半田、タンタルなどが挙げられる。リー トフレーム20の形成に用いた金鷹がメッキを要しない 全属またはメッキずみの全属である場合は工程をは省略 てさる。例えば、リードフレーム20形成用条片がニッ ケルパラジウムメッキを貼した鍋である場合は 工程5 は省略する。

[0040] 図4は図1の工程1-工程5終了後の図2 のリードフレーム20の斜視図である。この例では、工 程4にモールド処理を用いている。硬化したエンキャブ スレーション村のプロックがパッケージ本体51を形成 する。パッケージ本体51のテーパー付き側面55はタ ムバー29の内側にある。したがって、リード30の藁 出却分はパッケージ本体51の側面5 1とダムバー29 との間で延びている。

[004]] 図1の工程6はエンキャプスレーションず みのリードフレーム2 () (図4) を図2の根A-A、B - B. C-CおよびD-Dで切断する。図2を無額する 【① ① 38】工程4のモールド処理の代わりに工程4を 30 と 工程6はダムバー29の内側でリード30を切り離 す(図3)。工程2も接続線30をダムバー29の内側 で切り触す。最後に、工程6はパッケージ完成品をリー Fフレーム20の切り捨て可能部分から切り離すことに よってパッケージ形成を充了する。

[0042] 工程6はパンチ、絶または同等の専断装置 を用いて行う。例えば、パッケージ本体35が図5に示 すようなモールド体である場合はパンチまたは個を用い る。パンチを用いる場合は、パッケージ完成品を単一の パンチ動作でリードフレーム20から切断する。バッケ ージを反転させて、タムバー29の内側でリート30を パンチで切断する。切断の位置は、パッケージ側面55 から延びるリート30の切断部分が長さ幸ミリメートル から倒えばり、ちミリメートルの範囲に入るように変え ることができる。

【0043】図5はこの発明によるバッケージ完成品5 0の断面図である。バッケージ完成品50は図2のリー トプレーム20て製造し、図4の状態からパンチで切り 難したものである。 バッケージをひのバッケーシ事体を 1はモールトで形成してある。 バッケーシ50は平面状

【0044】図2のリートフレーム20から製造したパ ッケージ5 ()の構造と整合して、図5 のパッケーシ5 () のダイパッド22はほぼ平面状の上側の第1の表面23 を有する。ダイバット22のこの第1の表面23の反対 側には、ほぼ平面状の第2の表面24と同様にほぼ平面 状の周縁部の第3の表面25とがある。第3の表面25 は第2の表面22を取り回んでおりその第2の表面22 から垂直方向に深さ「H)」だけ凹んでいる。第3の表 面25は垂直方向には第1の表面23と第2の表面24 10 との間に位置し、パッケージ本体51形成用のエンキャ プスレーション村で雇われている。 第3の表面25の下 のエンキャプスレーション村はダイパッド22がパッケ ージから垂直方向に引っ張られるのを防ぐ。第2の表面 22はパッケージ50の下側表面56て露出し したが ってパッケージ5 () の下側の第2 の表面5 6 の一部を形 成する。代替的実施例では、ダイバット22はバッケー ジ本体の内部に完全に含まれる。

【0045】図5において、半導体集積回路ダイ52は ダイバッド22の第1の表面23に付着させてある。ダ 20 面55でリード30を切断する。 イ52のポンディングパット53の各々とリート30の 第1の表面との間をポンティングワイヤ5.4で技術す

[0046] 図5のパッケージ50は複数のリード30 を含み、これらリードの各々は図2のリートフレーム2 ()から第2の表面32のダムバー29の内側の点で切り 難したものである。切り離されたリード30の配置と数 はパッケージ製造に用いたリードフレームおよび用途に 応じて変わる。例えば、図2の場合のようにリード30 には直根状のものも曲げ部を含むものもある。

【0047】図2の場合と同様に、切り離しずみのリー F3()の各々はほぼ平面状の第1の表面31と その反 対側のほぼ平面状の第2の表面32と 同様に反対側の ほぼ平面状の第3の表面33とを含む。第3の表面33 はエンキャプスレーション村による被覆を受けるように 第2の表面32から深さ「H1」だけ垂直方向に凹んで いる。すなわち、第3の表面33は垂直方向には第1の 表面31と第2の表面32との間に位置する。リード3 ()の第2の表面32はエンキャプスレーション計には環 われず、パッケージ50の下側表面56て舞出する。

【0048】図5において リート30の第1の表面3 1のうちパッケージ本体51の内部にある部分はタイパ ッド22の第1の表面23と同し水平面内になる。タイ パッド22をモールト内で上に上げた領道の代替の実施 例(図示してない)では、リート30の第1の表面31 のうちパッケージ本体51の内部にある部分は上がった ダイパッド22の第1の表面23よりも低い水平面内に ある.

【0049】図5の切り離しずみのリート30の番ヶは パッケージ側面もちから横に延びる切断端部でもを含

み、リート30の第2の表面32の幾余の水平部分わよ ひ下側パッケージ表面56に対し傾斜角hetaを成すように 曲げてある。角度hetaは約 1.5° 乃至 7.0° の範囲に設定 てきる。図示のとおり、リード30の第2の表面32の 上向き曲げ終端部35は露出している。 リート30のこ の曲げ終端部35の長さはバッケーシ側面55から例え ばり、15ミリメートルであるが、用途に応じてこの数 値は変えることができる。その数値範囲は舞ミリメート

16

ルから約0.50ミリメートルである。 [0050] 図5のリード30の曲げ終端部35の上向 きの曲げ部は工程6においてパッケージ50をリートフ レーム20からパンチ操作で切り離すスタンピングマシ ンで形成できる。代替の実施例(図示してない)では、 リード30の終端部35をバッケージ側面55に接触す るように、すなわち角度8を水平面とテーパー付きパッ ケージ側面55との成す角度と寄しくするように曲け る。さらにもう一つの代替実施例(図示してな(・) で は、図1の工程6で、リート30の切断端がパッケージ 側面55から債方向にはみ出さないようにパッケージ側

[0051]代替の実施例 (図示してない) では りー F 3 ()の切離しずみ端部35をパッケージ側面55から 水平面内で横方向にはみ出させる。すなわち、切離しず みの搖都35を図5の場合のように曲げるのでなく。 角 度θが器度に等しくなるようにリード 3 (1の残余の部分) と同じ水平面内で構方向に延ばすのである。上記工程 6 で匿を用いた場合にそのようなパッケージが得られる。 工程6に蛯を用いた場合は、必要に応じて曲げ工程を別 に退加して図5の形状の上向き曲げを形成する。

【0052】図6において 半田パンブ57をバッケー ジ5 ()と印刷配料基板(図示してない)との間に付着さ せる。半田パンプ57はリード30の第2の表面32に 接触し、リート30の曲げ端部35を覆っている。

[0053]代替の実施例(図示してない)では、ダイ パット22の森出した第2の表面24を丰田ペーストな とで印刷配線首仮に導着的に接続してパッケーン冷却に 備える。この冷却は熱伝導により行われる。

[0054] 図7は図5のバッケージ50の下側表面5 6を示す。パッケージ50の第2の裏面56はダイバッ 40 ト22の第2の表面24と 切断ずみのリート30の第 2の表面32と、硬化すみのエンキャプスレーション材 とから成る。リード30の第2の表面36は長方形の周 縁を有する。リート30の切離しずみ終編部35は下側 表面56の確からわずがに延びている。第2の表面32 は用途によって円形その他の多様な形状と寸法にするこ とかできる。ダイパット22の第2の表面24は長方形 の固縁を有するが、それ以外の形状にすることもでき

[0055] 図7では、リート30の年2の表面30を 56 パッケーン50の下側表面56で確合いに整列配置して

ある。リート3 ()の切離しすみの終編部3 5 は工側表面 56の周継から少し延びている。図8は代替的バッケー ジ61)の下側外表面61を示す。図8では、切離しずみ リード63の露出した長方形の第2の表面64(図9) をパッケージ6 ()の下側表面61の窓の少し内側で一列 に並べてある。これら第2の表面64はパッケージ60 の下側表面の周線から例えば約0.05ミリノートルの 位置に配置するが、この数値は用途によって変わる。代 替の実施例 (図示してない) では、第2の表面€ 4は長 方形でなく円形の畑球を有し、相互接続用半田床ラント 10 を形成する。

17

[0056] 図9は図8のバッケージ60を製造するた めのリードフレーム62のダイバッド22 およびリード 63のダムバー29の内側で見た断面図である。図9の リードフレーム62は図2および図3のリートフレーム 20とほぼ同じであり、リード63の垂直方向に凹ませ た下側表面の配列、数および位置を除いてリードフレー ム20と同じ方法で製造する。したがって、 重複説明は

[0057] 図2のリード30の場合と同様に、図9の 20 リード83はほぼ平面状の第1の表面31と同様にほぼ 平面状の反対側の第2の表面64とを含む。第2の表面 64はパッケージの外部コンタクトとして作用する。 し かし、図2および図3のリードフレーム20の第2の表 面の場合と異なり、図9のリート63の第2の表面64 はダムバー29(図2)のすぐ内側またはすぐ近傍には 位置せず、リード63の第3の表面66および第4の表 面65の間でダイパッド24により近く位置している。 第3の表面66と第4の表面65は第1の表面31と反 対側にあり、ほぼ平面状であり、同一平面内にあり、リー30 二つの外側リード73の後方にあるからである。 ード63の第2の表面64から深さ「H1」だけ垂直方 向に凹んでいる(すなわち 垂直方向には第2の表面3 1と第2の表面64との間にある)。第4の表面65は 構方向にはダムバー29(図示してないが図2の場合と 同じ)と第2の表面64との間にあり、第3の表面66 は第2の表面64とダイバッド22との間にある。

【0058】図8および図9のリード63の第2の表面 64の国縁は多様なパッケージ外部技統を容易にするよ うに多様な形状にすることがてきる。例えば、この第2 の表面6.4 は図8の場合のように長方形の周線を備える。40。 形状にすることができ、また円形の周線を備える形状に することもできる。

[0059]図10は図8のパッケーン60の断面図で ある。図10のバッケージは図1の処理に従い 図9の リードフレームを用いて製造する。図示のとおり(第4 の表面6.5はパッケージ側面5.5に隣接し、第2の表面 はパッケージ6 0の下側表面6 1の周線端から所定距離 だけ内側にある。

【0060】図8および図1りにおいて、バッケーシ本 体を形成するエンキャプスレーション付かリートの3を、50、イ52の下側表面89とタイパッ172の第1の外面8

その第2の表面64を除き全部覆っている。すなわら、 リート63の第3の表面66および第4の表面65はエ ンキャプスレーション材で覆われておりしたがってパッ ケージ内部にある。リードの切断蟾郎がパッケージ側面 から延びている代替の実範例(例えば図5)では、エン キャプスレーンョン材はバッケージ側面から延びたリー 上切断部を疑っていない。

18

【1)()6]]図|]は図]の方法で製造可能なこの発明 によるもう一つのパッケージの断面図である。図11は 図12の根11-11で見た断面を示す。ダイ52を憧 用のエポキシダイ接着剤87によりダイパッド72の上 側の第1の表面82に付着させてある。ダイ52はダイ パッド72の風味部を越え またパッケージ70のリー ト72の上側の第1の表面76を越えて延びている。し たがって、パッケージ70の大きさはチップの大きさと ほぼ同じにある。ダイ52の側面52Aとパッケージ側 面17との間の距離はポンディングワイヤのある側では 杓0. 6ミリメートルほどにすぎない。代替の実施例 (図示してない) では、ダイ53はダイパッド72の周 緑を絶えて延びるが、リート73を絶えて延びることは ない。もう一つの代替の実施例(図示してない) すな わちポンティンクワイヤがダイの4辺全部になく2辺だ けにある実施圏では、ポンティングワイヤの接続のない ダイ側面52Aとパッケージ辺との間の距離はごく小さ くり、1ミリメートルほどである。

[0062] 図11には四つのリード73が示してあ る。二つの内側のリード73の長さの一部だけがこの図 には示してある。これら内側のリードが図13のリート プレーム71で示すとおり横方向曲げを含み、それらが

[0063]図11において、短いポンティングワイヤ 77がタイちちの上のポンティングパット53の各っと リート73の上側の第1の平面76との間に接続してお る。ポンティンクワイヤ77の第1の表面76への接続 はリート73の第1の486でパッケーシ側面79に腕 接して行う。

【0064】図11のパッケージ70はボールグリット アレーバッケージであるが、ラントグリップアレー(L GA)パッケーンも可能である。図12に示すとおり、 相互接続用半田球78のアレーをバッケージ70の下側 外面80に形成する。したかって、互いに異なるリート 37の第2の表面74とパッケーシ側面79との間の距 難は変わり得る(図12参照)。

[0065]図11のバッケージ本体81はモールトし たエンキャプスレーション村で形成するが、これ以外の エンキャプスレーション方法も可能である。図1の工程 4の期間中に、ダイち2の下側表面89とリート73の 第1の表面との間をエンキャプスレーション材か満た す。非得高性(すなわら絶縁性)の結若材エホキンを? 2との間に入れ ダイ52をダイバット72に付着さ せ、ダイ52をリード73の第1の表面76の上に間隔 を隔てて保持する。また、ダイ52がリード73を趋え て延びている場合は、追加の絶縁性エポキシ87をダイ 55の下側表面89とリート73の第1の表面76との 間に入れ、ダイちちとリートで3との間に間隙を設け 3.

[0066] 図11のリート73の各々はほぼ平面状の 第1の表面76を有する。第1の表面76の反対側には 同様にほぼ平面状の第2の表面74および第3の表面7 10 5がある。第2の表面74は各リード73の第1の28 6と反対の第2の鑑85にある。これと対称的に「図6 のパッケージ5 ()のリード 3 ()の第2 の表面 3 2 の位置 および図8のパッケージ60のリート63の第2の表面 64の位長はそれぞれのバッケージの下側外面の周縁上 またはその近傍にある。

[0067]図11において、各リート73の第3の表 面75はリード73の第2の表面74に隣接しその第2 ・ の表面74から深さ「Hl」だけ垂直方向に凹んでい る。この第3の表面75は垂直方向には第1の表面76 20 3のいくつかはダムバー29から第2のリート指85 と第2の表面74との間にあり、上述のとおり図3およ び図5のリード30の第3の表面33と同じ部分エッチ ング処理で形成する。図示のとおり エンキャプスレー ション材が第3の表面75を覆い、リート73がパッケ ージ本体81から垂直方向に引っ張られるのを防いてい る。エンキャプスレーション材はリート73の第2の表 面を覆っていない。

[0068]図11のパッケージ70の第パッド72は ほぼ平面状の第1の表面82を有する。第1の表面82 の反対側には、同様にほぼ平面状の第2の表面83と周 妹のほぼ平面状の第3の表面84とがある。第3の表面 84は第2の表面83を取り囲みその表面83から深さ 「H1」だけ垂直方向に凹んでいる。 ダイバット70の 第1の表面82はリード73の第1の表面76と同じ水 平面内にある。

【0069】図11のダイパッド72の第3の表面84 は垂直方向には第1の表面82と第2の表面83との間 にあり、図3および図5のダイバッド22の第3の表面 23と同じ部分エッチング処理で形成する。図11に示 の第3の表面84を覆い タイパット72が垂直方向に パッケージ本体81かち引っ張られるのを防いている。 エンキャプスレーション材はダイバット72の第2の表 面を覆っていない。パッケージ俗却を容易にするため に、ダイパット72の第2の表面83を半田はまたは同 等の導体で外部の印刷配線基板に接続することもでき る。代替的に ダイバッド72を図1の工程4で上側に 設けて、ダイバッド72をエンキャブスレーション材で 覆いパッケージ本体81の内部に取り込むこともてき る。その場合は、リート73の第1の手面76はタイパーが、でも形成するリートフレーム71の数は変更できる。例

ット72の第1の表面82の下に位置つけられる。 【0070】図12は図11のパッケージ70の下側外 面8 ()をリード73の第2の表面74に半田はを配置す る前の状態で示した平面図である。図示のとおり 第2 の表面7.4 は円形でありアレー状に配置されている。リ ート73の第3の表面75はこの図では見えない。すな わち 第3の表面75はエンキャプスレーション計で競 われ、したがってバッケージ本体81の内部にあるから である。全席の角板88を下側表面80の四つの角の各

っに配置する。 [0071] 図13は図11および図12のパッケージ 71)の製造に直したリードフレーム71の平面図であ る。図2の長方形のダイパッド22と異なり、図13の ダイバット72はダムバー29の互いに平行な二つの辺 に接続された分割型条片である。ダイバット72は四つ の長方形部分7.2を含み、これら四つの部分をバッケー シ冷却のために印刷配接基板に半田珠で接続する。

【0072】図13のリート73は用途に応じて多様な 形状および長さにできる。より詳細にいうと、リード7 (図 】】)における円形の第2の表面74に至る戻延部 で慎方向に真っ直ぐである。またそれらリード73の他 のいくつかはダムバー29と第2のリート線85(図) 1) における第2の表面74との間で一つ以上の操方向 曲げ部を有する。リートフレーム71の各角部における 二つのリート73は同一のリート鑑86に接続してある が、これは必須ではない。代替の実施例(図示してな い) では、リード73にエンキャプスレーション村との 絡み合せのためのアンカー耳部を設ける。図1の工程6 において、各リート73を図13のダムバー29の内側 てリードフレーム71から切り離す。この切断はダムバ ー29の内側で、リートフレーム71の図13の線A = A B-B、C-CおよびD-Dにおける全居製角部材 88の端の外側で行う。

【ロロ73】上述のパッケージ、リートフレーム 組立 て方法などには、この明細書に基づさ多数の変形が可能 であることは当業者に明らかであろう。例えば「四14 は、複数のパッケージを図5、図10または図)!に従 って同時並行的に製造する代替組立て方法の流れ図であ すとおり、エンキャプスレーション村かタイパットでで、40~る。図1.4 の昔本的工程は図1.の場合と同じてあり、し たかって、各工程の詳細な説明は不要であるう。図1の 処理と図14の処理との差は複数パッケーシの同時並行 製造を可能にするようにする工程が改変されていること たけである。図14の処理は工程1においてリートフレ ーム20、62 71などの複数のリートフレームを一 つの全席条片シート上にマトリクスの形でエッチングに より近接形成することによって可能になる。

[① 0 7 4] 図15は全属条片90上の12個のリート アレームで1のマトリクスを示す。条件90にエッチン

えば、粂片91に36個または64個のリートフレーム 91をエッチングで形成できる。リードフレーム91 は、上述の2段階エッチング手法または2段階順送りス タンピングおよび化学エッチング手法を用いて 条片9 ()に同時並行的にエッチングで形成したものである。図 15の形状については、図14の工程4を上述のとおり 慣用のモールト手法を用いて行い、条片90の各リート フレーム71上の個々のパッケージ本体81を形成でき る。すなわら、型は各ダイに対して個々の型空動を傷 え、図4の場合と同様に国々の不完全なパッケージのアー10 レーを形成する。工程6はパンチまたは蛯を用いて個々 のパッケージを条片9()から切断する。

21

[0075]図16は8個のリードフレーム20(図 2) の二つのマトリクスをエッチングにより形成する代 替の条片93を示す。図14の工程4の期間中に個々の パッケージをモールトする代わりに 二つのマトリクス の各々のリードフレーム20全体にわたってエンキャブ スレーション村の1プロックを坐布する。 これらエンキ +プスレーション材のブロックは、図16のリードフレ ーム20の各マトリクスの周囲にHYSOL4451接 20 【図13】図11および図12のバッケージの製造のた 者剤ビーズをまず途布することによって行う。ビーズ硬 化ののち、HYSOL4450液状エンキャプスレーシ ョン村またはその同等品をピーズ内に食布し、各ダイ5 2およびダム内側の加工中のパッケージ50をエンキャ プスレーション材で覆うようにする。次に、エンキャブ スレーション村を加熱などにより硬化させ、リードフレ ーム20の二つのマトリクスの各々の上にエンキャプス レーション材の連続したプロックを形成する。図14の 工程6では、8個の別々のバッケージ50を二つの条片 93の各々から切り載すのに据を用いる。工程6はリー 30 ドフレーム20とダイバット22とリード30との間を 切断する。また 工程6は直交状パッケージ側面を形成 するようにエンキャプスレーション村を切断する。

[10076] この発明の実施例の上述の説明は例示のた めのものであって限定を意図するものではない。この明 細書から、上記以外の実施例が当業者には目明である **٠**.

【図画の簡単な説明】

【図1】パッケージ製造方法の流れ図。

【図2】 パッケージ製造に用いるリートワレームの平面 40 53 ボンティングパッド54 ボンディングワイヤ

【図3】図2の棟3-3でダムバーの内側を見たタイパ

ットおよびリートの断面図。

【図4】図2のリートフレームのモールトしたエンキャ プスレーション村によるダイ付着およびエンキャプスレ ーション後の斜切区。

【図5】パッケーン完成品。 すなわちハッケージ本体を モールドしてパンチによりリートフレームから分離した パッケージ完成品の断面図。

【図6】リードの露出部分に半田パンプを付着させたあ との図りのパッケージの断面図。

【図7】図5のパッケージ下側表面の平面図。

【図8】代替パッケージの下側表面の平面図。

[図9] 図8のパッケージの製造のためのダイパットお よびリードのダムパーの内側で見た断面図。

【図】(1) 図8のパッケージの新面図。

【図11】ダイがダイパット風辺から損方向にリートの 長さの一部を越えてはみ出して延びている代替的バッケ ーンの断面図。

【図12】相互接続用半田珠を備えない図12のパッケ ージの下側表面の平面図。

めのリードフレームの平面図。

【図14】複数のパッケージを同時並行的に製造する方 柱の流れ図。

【図 15】全国条片のエッチングで形成した6個のリー トプレームの二つのマトリクスの平面図。

【図16】金属条片のエッチングで形成した8個のリー トフレームの二つのマトリクスの平面図。

21

タイパー

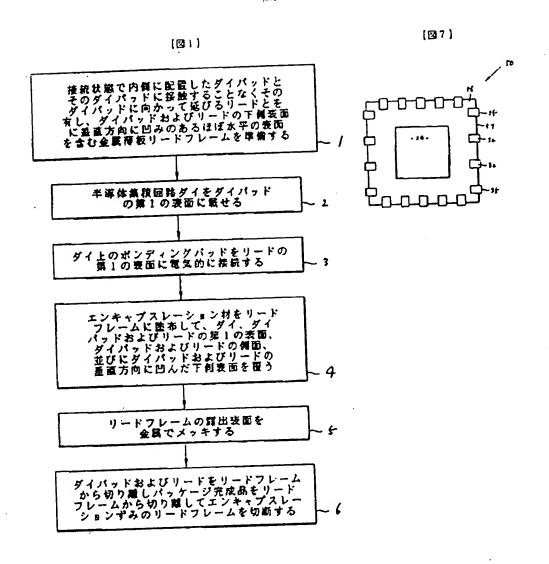
【符号の説明】

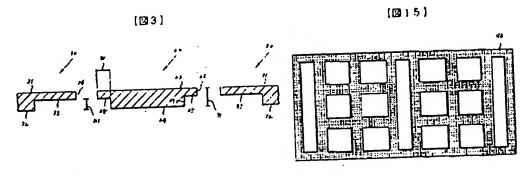
20 リードフレーム

0	22	ダイパッド	23	第1の表面
•		第2の表面	25	第3の表面
	26	第1の直交側面	27	第2の直交側面
		传统规	29	ダムバー
	3.0	リード		第1の表面
	3.2	第2の表面	33	第3の表面・
	3 4	リート先体		曲げ挑部
	36	アンカー耳部	50.	. 60 70 Nyth
	۶٠.			
	5.1	パッケージ本体	5 2	タイ
				4・.こう・. ガロイヤ

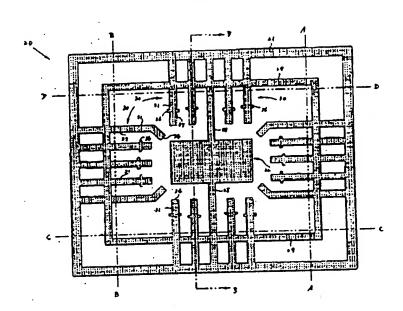
55 側面56 下側表面

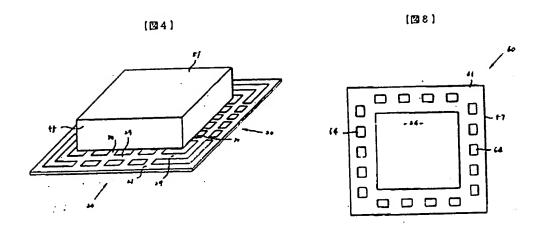
76 半田叶





[22]

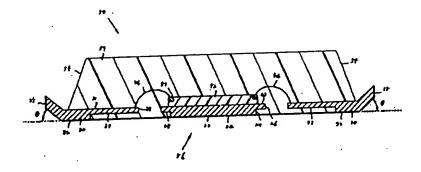




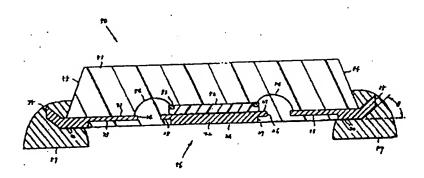
(15)

特別2000-150765

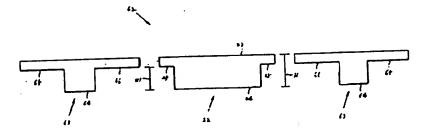
(図5)



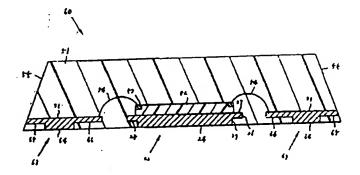
[26]



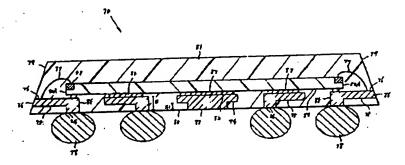
[29]



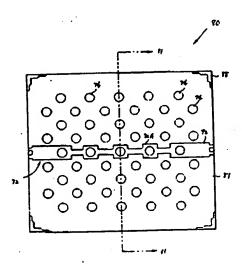
[210]



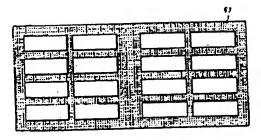
[図11]



[212]



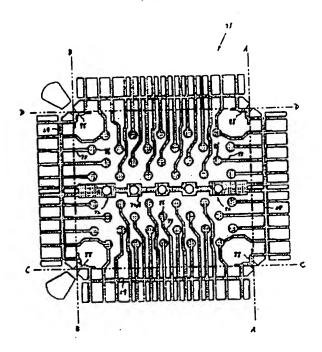
[2] 16]



特闘2000-150765

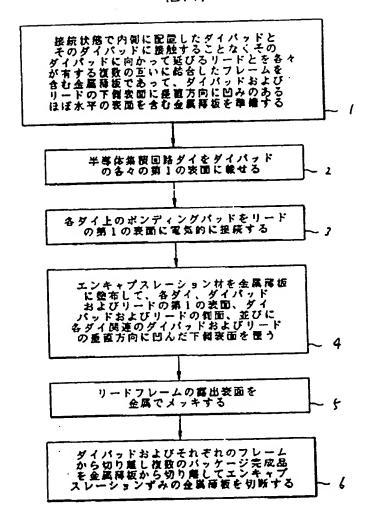
(17)

[213]



may commonwhere and property

[214]



プロントページの続き

(72)発明者 トーマス ビー、グレン アメリカ台衆国 アリソナ州 85233 キ ルハート、サウス クラウン キー コー ト 1001

(72)発明者 スコット ジェイ、ジュウラー アメリカ台衆国 アリソナ州 85296 キ ルバート、イースト アラヒアン コート 1436 (木)発明者 ディクテッド ロマン アメリカ合衆国 チリソナ州 85284 デ ンブル、ウェスト パロミーノ トライフ 428

(元)発明者 シェイ、エッチ、イー 、 韓国 ソウル、カンドンーク、アムサート ン ラントンアパートメント 7-202 (19)

特別2000-150765

וווון וואשאים וויים אין פען וויים וו

(72)発明者 ディー、エッチ、ムン 韓国 ソウル、クッンジンーク、クンジャ - ドン 465-7

3/3/03 9 38 Ali